FBAR 等の RF-MEMS 素子における2次元 振動分布を高速に観測する技術を開発

国立大学法人 千葉大学(以下、千葉大学) 橋本研也教授・山口正恆教授の 研究グループは、独立行政法人 日本学術振興会、独立行政法人 科学技術振興 機構、財団法人 三菱財団からの援助を受け、ネオアーク株式会社(以下、ネオ アーク)の協力の元に、薄膜バルク波共振子(以下、FBAR)に代表される高周波 マイクロ電気機械システム(以下、RF-MEMS)素子における2次元の振動分布を高 速に観測する技術の開発を成功しました。今回開発した技術により、RF-MEMS素 子の詳細な動作解析を可能とし、その開発時間短縮と共に高性能化が可能とな ります。

本技術の詳細は11月26,27日に日本大学理工学部(東京都御茶ノ水)で開催 される「最新のMEMS技術を利用した圧電デバイスに関する国際ワークショップ」 (<u>http://www.ieice.org/jpn/kikaku/tc49/index.html</u>)において紹介されます。

開発の背景

現在の移動体通信機器では、高い周波数選択性を持ち、かつ小型で・低損失 な弾性表面波(以下 SAW)素子が多用されています。理論限界に近い性能実現が 要求される現在では、より一層の性能向上の手がかりを探索するために、素子 の動作と直結した弾性波の伝搬姿態を観測する手段が渇望されています。

この様な観点から、千葉大学の研究グループは、ネオアークの協力の元に、 超高周波帯での微小な振動を高感度で、しかも2次元的に超高速測定する装置 (以下、SAW 観測装置)を開発してきました。現在、2,5 GHz 動作の SAW デバイ スにおける二次元振動分布を20分程度で高解像度に2次元観測できる様になっ ています。この装置は、様々な企業・研究機関からの利用依頼を受ける等、SAW 素子用診断ツールとして高い評価を受けております。

SAW 観測装置では、図1に 示すナイフエッジ法を利用し て、入射レーザ光のたわみ振動 による偏向光を選択的に検出 しています。たわみ振動のみを 検出するため、床や駆動モータ 等から発生する低周波の縦振 動に鈍感であり、その結果、被 測定対象の高速走査でも測定 結果が乱れず、高速・高精度な



図1 ナイフエッジ法による弾性振動の検出

2次元計測が可能です。しかも、振幅ばかりでなく位相も同時に観測可能であり、 様々な情報抽出や画像処理が可能です。

課題

最近、超高性能の高周波フィルタや半導体 IC と集積化可能なフィルタとして、 FBAR 素子に代表される RF MEMS フィルタが注目を受けています。この素子の 場合、厚み方向の縦波振動が主成分である場合が殆どです。このため、ナイフ エッジ法を利用した SAW 観測装置では振動を検出できません。そのため、それ を高感度に、超高速で2次元観測する装置の開発が望まれていました。

厚み方向の振動を観測できる観測系としてマイケルソン干渉計が知られてい ますが、この手法の場合、床や駆動モータ等から発生する低周波の縦振動に観 測結果が乱されてしまいます。このため、頑丈な除振台を設置し、さらに駆動 速度を低下してモータからの振動を抑圧する必要がありました。これでは計測 に長時間要してしまうため、特殊な方法を利用して振幅のみを測定することで 計測時間を短縮することが殆どでした。

開発した技術

今回、SAW 観測装置の光学系 へ、これまでのナイフエッジ法 に代わりサニャック干渉計を適 用し、縦振動観測可能な観測装 置(以下、RF-MEMS 観測装置) を新たに開発しました。

サニャック干渉計は、同一経路を右回りする光と左回りする 光間に発生する位相差により干渉が発生します(図2参照)。

この干渉光強度は周波数に比 例するため、本質的に低周波振 動に対して感度が低く、所望の 高周波縦振動のみを超高速に2 次元計測できます。

このため、ナイフエッジ法の 様々な特長をそのまま生かしな がら、縦振動を選択的に観測で きます。



図 2 サニャック干渉計の構成(PBS: 偏 光ビームスプリッタ)

このサニャック干渉計は、低周波振動検出やジャイロ等の光ファイバセンサ に広く利用されていますが、高周波弾性振動の検出にはあまり利用されてきま せんでした。 今回、この干渉計を微小光学系により構築しました。これにより、小型で、 経時変化が少なく、しかも最高周波数2.5 GHz付近まで高感度に縦振動が観測可 能となりました。

また、SAW観測装置のために開発された様々なソフトウェアやハードウェア、 ノウハウはそのままRF-MEMS観測装置に移植でき、短時間での装置開発が可能 となりました。

効果

図3にこの装置を利用して観測した FBAR における不要共振の振動振幅分布 を示します。素子の駆動周波数は1.82 GHz、観測点数は500-750 (X-Y)で、400 nm ステップで計測しています。この時の観測時間は全部で約10分です。ちなみに、 観測時間はY方向の測定点数でほぼ計測時間が決まります。

楕円状の部分は FBAR が構成されている部分であり、2つの長方形は FBAR を挟みこんでいる上下の電極です。FBAR 部にエネルギーが集中しているが、分 割振動している様子が見て取れます。ちなみに、振幅と位相の両データを利用 することにより振動の様子を動画像として表示することもでき、より直感的に 理解できるようになります。この様なデータは素子の動作を理解し、更なる性 能向上を目指す上で重要な様々な知見を与えます。

なお、この時の振動振幅は 50 pm (ピコメートル、10 の-12 乗メートル)と概算 されます。



工学写真像 振幅分布 図3 FBAR における振動分布の観測例 (1.82 GHz)

これにより、GHz帯でも高感度に縦振動が観測可能なことを示し、この干渉 計が低周波振動に鈍感なために高速2次元走査が可能なことを実証されました。 また、図4に、1 GHz 動作の SAW デバイスにおける二次元振動分布を観測した例を示します。この時の測定点は 460-300 (X-Y)で、1μm ステップ、計測時間は 10 分程度です。

縦縞が見えますが、これは交差指電極が周期的に並んでいる部分で、その線 と空隙の幅は1µmです。交差指電極部にエネルギーが集中している様子が見て 取れます。また、周囲の電極部や交差指電極部外へエネルギーが漏れ出してい る様子も判ります。この装置はFBAR ばかりでなく、SAW 観測装置としても十 分な性能を有していることが判ります。



図4 SAW 共振子における振動分布の観測例 (1 GHz)

今後

測定試料のアライメントや測定パラメータの設定等の簡略化・自動化を目指し、RF-MEMS/SAW 観測装置としての製品化を目指します。

以上

注釈

注1 国立大学法人 千葉大学: 学長 古在豊樹(こざい とよき)、本部 千葉県千葉市。 注2 ネオアーク株式会社:

代表取締役 城和彦(じょう かずひこ)、本社 東京都八王子市

本件に関するお問い合わせ

千葉大学大学院工学研究科人工システム科学専攻 教授 橋本研也 電話:043-290-3318 E-mail: k.hashimoto@ieee.org

ネオアーク株式会社 製造技術部 部長 赤羽 浩一 電話:042-627-7211 E-mail: akahane@neoark.co.jp

ネオアーク株式会社 東京営業部 小林 善紀 電話:042-627-7671 E-mail: y.kobayashi@neoark.co.jp